



佐賀大学 SAGA UNIVERSITY

理工学部 FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING

2026 年 7 月 7 日

大津 康德 教授が分担執筆した
「半導体プラズマプロセス技術の制御と計測・モニタリング」が
出版されました

【概要】

電気電子工学部門 大津 康德 教授が分担執筆を担当した専門書「半導体プラズマプロセス技術の制御と計測・モニタリング ～可視化・異常検知・高精度プロセス最適化～」(技術情報協会)が 2026 年 6 月 30 日に出版されました。

【本文】

電気電子工学部門 大津 康德 教授が分担執筆を担当した専門書「半導体プラズマプロセス技術の制御と計測・モニタリング ～可視化・異常検知・高精度プロセス最適化～」が技術情報協会より 2026 年 6 月 30 日に出版されました。

本書は、大学の学部上級以上の学生を対象として、半導体プラズマプロセス研究分野における制御と計測に関するトピックについて、第一線の研究者らが分担して執筆した解説書です。大津 教授は、第 7 章第 7 節「ホロー電極を用いた高周波プラズマの高密度化とレジスト剥離の高速化」を担当しました。

書 名：半導体プラズマプロセス技術の制御と計測・モニタリング～可視化・異常検知・高精度プロセス最適化～

執 筆 者：林 康明，八田 章光，佐々木 浩一，林 俊雄，吉村 信次，大津 康德，
他 3 2 名

出 版 社：技術情報協会

ISBN : 978-4-86798-156-6

URL : https://www.gijutu.co.jp/doc/b_2357.htm